

大分工業高等専門学校、日本電子株式会社、 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 共催 ジョイントセミナーのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

昨今、ナノ材料や複合材料、ファインマテリアルなどの分野で電子顕微鏡を用いた高倍率観察や微量元素分析・結晶方位解析のニーズが高まっています。また、コーティング材料の多様化やデバイス微細化により、「FE-SEM/EDSを用いた微小領域の膜厚評価」という新しいニーズが生まれています。

今回のセミナーではこのようなFE-SEM観察、分析に関する問題を1台の装置で解決するための発表をさせていただきます。
奮ってご参加頂ければ幸いです。

敬具

『FE-SEM & EDS / WDS / EBSD セミナー ～高倍率SEM観察から元素分析・結晶方位解析・膜厚分析まで～』

日時：2015年1月15日(木) 13:00～16:00

会場：大分工業高等専門学校
(会議室)

プログラム (開場: 12:30)	
13:00-13:05	開会のご挨拶
13:05-13:50	「FE-SEMの基礎と観察活用例」 日本電子株式会社
13:50-14:20	「EDS/WDSの原理と分析活用例」 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
14:20-14:50	「EBSDの原理と分析活用例」 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
14:50-15:00	休憩
15:00-15:30	「装置見学会」 大分工業高等専門学校
15:30-15:55	「LayerProbeソフトウェアを用いたFE-SEM/EDS膜厚分析と解析例」 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 大分工業高等専門学校
15:55-16:00	閉会のご挨拶



セミナーに関するお問い合わせ
〒870-0152 大分市大字牧1666番地
大分工業高等専門学校 総務課企画係
TEL : 097-552-6450
FAX : 097-552-6106
E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp

FE-SEM&EDS/WDS/EBSD ジョイントセミナー

【日時】 2015年1月15日(木)
13:00 ~ 16:00 (開場12:30)

【参加費】 無料

【定員】 50名

【会場】 大分工業高等専門学校
会議室
〒870-0152 大分市大字牧1666番地



独立行政法人 国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校

Oita National College of Technology



会場案内図



【アクセス】(<http://www.oita-ct.ac.jp/guide/access.html>)

JR大分駅前から大分バスで約20分

- ①「大分駅前6番のりば(府内中央口)」または「大分バス本社前6番のりば」
- ②「大分駅前3番のりば(府内中央口)」または「大分バス本社前3番のりば」

【お申し込み方法】

以下、お申し込みご記入欄に必要事項をご記載の上、FAXあるいはメールにてお申し込み下さい。

＜セミナー参加申込先＞

大分工業高等専門学校 総務課企画係

FAX : 097-552-6106

E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp

申込書(お申し込みご記入欄)

貴社名:	
部署名:	
ご住所:	〒
お名前:	
TEL:	
FAX:	
E-mail:	



The Business of Science®

セミナーに関するお問い合わせ
〒870-0152 大分市大字牧1666番地
大分工業高等専門学校 総務課企画係
TEL : 097-552-6450
FAX : 097-552-6106
E-mail : kikaku@oita-ct.ac.jp